

# FPM/M・R型 カスタムプローブ・ステーション

## 製品の特徴 卓上型コンパクトサイズから中型サイズまで自由設計、低コスト・高コストパフォーマンス

本製品は半導体チップや電子デバイスの電気特性(DC~高周波・RF)測定、化学・物理研究分野での材料・素材の観測用のために各基本パーツを組み合わせてプローバーを製作します。個々のご要求・ご用途・ご予算に応じて最適な仕様でカスタマイズしてご提供致します。

当該製品は、手動(マニュアル)及び外部制御(簡易形・PC制御式選択可)タイプを用意しております、例えば、グローブ・ボックス(外気と遮断する場合やガス封入雰囲気状態での測定)内にプローバーを入れて操作する場合は外部制御式がお勧めです。

### 基本構成・オプション・オーダー方法

- ・ ベースプレートサイズ:300×400mm(最小)から任意サイズ
- ・ プローブアームポジション:基本左右(E東・W西)  
オプション;上下(S南・N北)追加45度方向にも最大全6個設置が可能  
ポジション: X-Y-θ (あおり調整)高精度型(マイクロメータ式精度10μm)
- ・ DUT設置台: X-Y-AZ(回転調整)、バキューム、磁力、静電吸着選択可  
オプション;サーマルチャック(温度範囲-40~+300℃)対応可
- ・ 顕微鏡:実体式、デジタル式各社製選択可(GCDカメラ、外部モニタ可)
- ・ 除振台:パッシブ・アクティブ型選択可(弊社ではヘルツ社製を推奨)
- ・ PC制御の場合のPCはWindows VISTA、7、8、8.1(32 or 64bit)が正常に動作するマシンが条件です、制御用ソフトもご要求に応じて対応致します。

その他、仕様・詳細は別途お打ち合わせにより決定して行きます、可能な限りお客様のニーズに合わせた形に仕上げさせていただきます。

### 型式 FPM-□□□□○◇-△ に付いて

□部分はベースプレートサイズ(縦×横cm)、○は特別仕様、◇はM=手動式・R=外部制御式どちらか選択、△はファクトリー・リザーブ

測定対象(DUT)に合わせて設置台のサイズや仕様を決め、プローブアーム数(東西南北)や手動・外部制御などを決定します、ポジションはX-Yとあおり(θ)の3軸が基本です、位置決め精度は10μmから。

外部制御式の場合は、簡易的なものはPCレスでジョイスティック式、PC制御式はLCD画面にてマウス・コントロールが可能です。



### プローバ概観例

マニュアル形小型プローバーの例; 重量約15kg~、(顕微鏡・除振台は含まず)

